

전자유도식 변위센서 (LVDT) indu**SENSOR**

공압 슬라이드 밸브 위치

공압 제어 밸브는 화학 공학에서 액체 및 기체 매체를 조절하기 위해 사용됩니다. 지속적으로 높은 수준의 공정 신뢰도를 보장하기 위해서는 유량을 정확하게 제어해야 합니다. 슬라이드는 공압식으로 구동되면서 유량의 오픈부를 변경합니다. 슬라이드 위치를 측정하는 전자유도식 변위센서가 슬라이드에 연결됩니다. 마이크로컨트롤러는 폐회로 제어, 매개변수화, 제어 밸브의 버스 연결과 함께 변위센서의 제어 및 평가를 처리합니다. 컨트롤러가 이미 존재하기 때문에 소수의 수동 구성요소 외에 사실상 코스트 없이 위치를 측정할 수 있습니다.

특히 이 어플리케이션의 결정적인 요소는 바로 비접촉식 측정입니다. 포텐셔미터와 달리, 작동 시 전혀 마모되지 않고 열악한 조건(예: 배관 진동)에서도 제한 없는 사용 수명을 보장합니다. Micro-Epsilon 솔루션의 이러한 장점 덕분에 고객은 작동이 간편한 고 품질의 튼튼한 제품을 경쟁력 있는 가격으로 시장에 출시할 수 있습니다.

장점

- 열악한 산업 환경에서 비접촉식 측정 (진동)
- LVDT-원리 DTA-6D-20, 경제적인 마이크로컨트롤러 작동 포함 (특히 MICRO-EPSILON)
- 마이크로컨트롤러로 측정 범위 교정
- 적합한 가격 및 고객별 센서 디자인

